



WPI-AIMR and Fraunhofer ENAS Joint Workshop on Micro Integrated Devices

日時：2013年2月22日（金）

場所：東北大学 青葉山キャンパス 青葉記念会館4階

(<http://www.eng.tohoku.ac.jp/map/?menu=campus&area=c&build=03>)

10:00 – 10:10	開会挨拶 小谷元子（東北大学 WPI-AIMR 機構長）
第1部 NEMS/MEMS とナノ材料を活かした受動素子（JST-DFG 日独研究交流成果報告）	
10:10 – 10:30	樹脂接合による MEMS-LSI のヘテロ集積化 江刺正喜（東北大学 WPI-AIMR）、田中秀治（東北大学 工学研究科）
10:30 – 11:00	マイクロ・ナノ技術によるスマートシステム集積化 Prof. Thomas Gessner (Fraunhofer ENAS, Chemnitz University of Technology, WPI-AIMR)
11:00 – 11:25	ナノ材料の集積化による3次元インダクタ Dr. Yu-Ching Lin（東北大学 WPI-AIMR）
11:25 – 11:50	NEMS/MEMS 製作における機能性液体 Mr. Felix Gabler (Fraunhofer ENAS, Chemnitz University of Technology)
11:50 – 12:15	異種基板のウェハレベル低温接合 Mr. Jörg Frömel (Fraunhofer ENAS, Chemnitz University of Technology, 東北大学 Fraunhofer Project Center)
Lunch break	
第2部 機能性材料の集積化	
13:30 – 14:00	[特別講演] デバイス応用に向けたデアロイ化によるナノポーラス金属 Prof. Mingwei Chen（東北大学 WPI-AIMR）
14:00 – 14:30	[招待講演] Nd 添加 PZT 薄膜による広走査角圧電 MEMS ミラー 直野崇幸（富士フイルム）
14:30 – 14:50	金属ガラス薄膜を用いた MEMS スイッチ Mr. Yu-Lang Chu (Fraunhofer ENAS, now GI3 Lab of WPI-AIMR)
14:50 – 15:10	磁性金属ガラス薄膜による MEMS マイクロミラー Dr. Yao-Chuan Tsai（東北大学 WPI-AIMR）
15:10 – 15:30	L10FePt によるパターン記録メディアの製作 Dr. Neelam Kaushik（東北大学 WPI-AIMR）
Coffee break	
第3部 マイクロデバイスとその製作	
15:45 – 16:15	[招待講演] MEMS 技術による高性能 RF デバイスの開発 池田浩一（ソニー）
16:15 – 16:35	集積化触覚センサデバイス 室山真徳（東北大学 WPI-AIMR）
16:35 – 16:55	高スループット細胞分析のための局所酸化還元サイクルによる電気化学チップ 伊野浩介（東北大学 環境科学研究科）
16:55 – 17:15	筋肉組織を作るマイクロ技術 Dr. Samad Ahadian（東北大学 WPI-AIMR）
17:15	閉会挨拶 江刺正喜
Closing	
18:00 – 20:00	交流会

言葉：英語 | 参加無料、当日直接参加可 | 交流会は2013.2.8まで申し込み必要（5000円）

問合せ・レセプション申し込み：東北大学 林育菁 E-mail: yclin@mems.mech.tohoku.ac.jp